

# 導電率傾斜機能材料による直流ガス絶縁開閉装置の 小型化とSF<sub>6</sub>ガス使用量削減 <sup>早川 直樹</sup> (名古屋大学)

# Reduction of Size and SF<sub>6</sub> Gas Volume in HVDC Gas-insulated Switchgears with Conductivity Graded Materials Naoki Hayakawa (Nagoya University)

## Abstract :

Functionally graded materials (FGM) with graded permittivity ( $\varepsilon$ ) and conductivity ( $\sigma$ ) are promising as one of the effective techniques for the reduction of size and SF<sub>6</sub> gas volume in high voltage direct current (HVDC) power apparatus such as gas-insulated switchgears (GIS) and transmission lines (GIL). Toward the practical application of FGM to HVDC GIS/GIL spacers, we investigated the electric field reduction effect and the discharge inception voltage enhancement effect of  $\varepsilon$  and  $\sigma$  graded materials ( $\varepsilon/\sigma$ -FGM). The results show that  $\varepsilon/\sigma$ -FGM spacer with grading to lower permittivity (GLP) ( $\varepsilon_r$  from 12.7 to 4) containing 0 to 26.9 vol% SrTiO<sub>3</sub>-filled epoxy composite and U-shaped graded conductivity containing 5 to 10 vol% SiC-filled epoxy composite is effective for electric field reduction under DC steady state and lightning impulse (LI) voltage. The discharge inception voltage of  $\varepsilon/\sigma$ -FGM spacer in SF<sub>6</sub> gas at 0.5 MPa-abs under LI voltage is also estimated to be 26% higher than that of conventional spacer without  $\varepsilon/\sigma$ -grading.

## 1. はじめに

快適かつ安心な都市の生活環境を維持し,持続可能な社会を創造するためには,社会活動のエネ ルギーインフラである電力機器・システムの高信頼・高効率化が必要不可欠である.現在の電力機 器・システムは発電所と都市を送配電網で結び,電力の流れを拠点変電所の開閉装置(スイッチ)の 開閉・切換で制御している.この開閉装置として、SF<sub>6</sub>ガスを封入したガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear: GIS)が主流であるが、SF<sub>6</sub>ガスの地球温暖化係数がCO<sub>2</sub>ガスの23,900倍と 高いことから、その使用量の削減が世界的に喫緊の課題となっている.また、地球温暖化抑制対策 としての太陽光発電や風力発電などの自然エネルギー由来の発電技術の普及拡大に伴い、その出力 特性や長距離送電の観点から、高電圧直流(High Voltage Direct Current: HVDC)送電技術の開発 が、昨今の世界的なキーテクノロジーとなっている.すなわち、高電圧直流ガス絶縁開閉装置 (HVDC-GIS)の開発およびその小型化とSF<sub>6</sub>ガス使用量削減が求められている.

このような社会的・技術的背景により、本研究では、HVDC-GISの小型化とSF。ガス使用量削減 に向けて、傾斜機能材料(Functionally Graded Materials: FGM)の適用を目指している.FGMは 「空間的に一つの機能から他の機能へと連続的または段階的に変化する一体の材料」として定義さ れる.GISのサイズは高電圧導体を電気的・機械的に支持する絶縁スペーサのサイズに支配される ため、FGMをスペーサに適用することによって小型化が可能となれば、GISとしてのSF。ガス使用 量の削減につながる.FGMのGISスペーサへの適用は筆者らのオリジナル研究であり、従来は主 として交流GISスペーサへの適用を対象としてきたが、本研究はFGMの直流GISスペーサへの適用 を目指すものである.本報告書では、まずFGMのコンセプトと交流GISスペーサへの適用実績を 紹介し、FGMの直流GISスペーサへの適用可能性について、基礎的な円錐台形スペーサへの適用 効果、実用的なコーン型スペーサへの適用効果に関する研究成果について述べる.

## 2. FGMのコンセプトと研究実績

### 2.1 FGMのコンセプト

GISスペーサは、主剤であるエポキシ樹脂にSiO<sub>2</sub>やAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>などの無機フィラーを混合することに より、スペーサとしての電気的・熱的・機械的特性を制御している. 同軸円筒構造を有するGIS内 部では、内円筒導体(高電圧)と外円筒導体(接地)との間にスペーサ(比誘電率 $\epsilon_r$ =4)とSF<sub>6</sub>ガス( $\epsilon_r$ =1)があるため、複雑かつガス中の電界が局所的に高くなる不平等電界分布が形成され、スペー サよりも絶縁性能の低いSF<sub>6</sub>ガス中の最大電界を低減するような絶縁設計が行われている.

ここで、同軸円筒導体 (内半径a、外半径b)の内円筒導体に電位V<sub>0</sub>を与えた場合、内円筒〜外円 筒間の誘電体 ( $\varepsilon_r$ :一定)の電界・電位分布は、ガウスの法則により、図1(a)のようになる.一方、  $\varepsilon_r$ が半径rに反比例的に減少 (傾斜) する場合の電界・電位分布は図1(b)となり、最大電界が緩和され るとともに、誘電体内部が平等電界となる.このような電界緩和は「理論的には可能であるが、技 術的・実用的な解決策はない」<sup>(1)</sup>と言われているが、これを技術的・実用的に解決する技術がFGMの コンセプトである<sup>(2)</sup>.従来は一定であるスペーサ内部の比誘電率を空間的かつ任意に制御すること



ができれば、SF<sub>6</sub>ガス中の電界を緩和かつ平等化し、GISとしての絶縁性能を向上するとともに、SF<sub>6</sub>ガス使用量を削減することが可能となる.

スペーサ内部の誘電率( $\varepsilon$ ), 導電率( $\sigma$ )または両方の空間分布を制御するFGMをそれぞれ「 $\varepsilon$ -FGM」,「 $\sigma$ -FGM」,「 $\varepsilon/\sigma$ -FGM」と呼ぶ. 交流GIS内部の電界は主としてスペーサの誘電率に支配 されるのに対して, 直流GIS内部の電界は主としてスペーサの導電率に支配されるため, 直流GIS への適用が期待されるFGMは「 $\sigma$ -FGM」または「 $\varepsilon/\sigma$ -FGM」である.

### 2.2 FGMの研究実績

筆者らが参画したNEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラム「電力機器用革新的機能性絶縁 材料の技術開発」プロジェクト(2017~2022, JPNP12004)<sup>(3)(4)</sup>では, ε-FGMを適用したGISスペー サが開発されている.同プロジェクトでは,交流245kV級GISスペーサを対象とし,スペーサ直径 を30%低減することにより,GIS断面積およびSF<sub>6</sub>ガス使用量を50%低減することを目的としてい る.

NEDOプロジェクトにおいて、可変配合注型法<sup>(5)</sup>で作製した245kV級コーン型 $\epsilon$ -FGMスペーサ (内半径45mm,外半径120mm)の外観を図2に示す.同図において、中心導体周囲の白色領域が高 誘電率層( $\epsilon_r$ =10)、外周部の黒色に着色した領域が低誘電率層( $\epsilon_r$ =4)、中間の段階的な灰色領域 が誘電率傾斜層( $\epsilon_r$ =4~10)である.  $\epsilon$ -FGMスペーサの負極性標準電インパルス電圧印加時におけ るSF<sub>6</sub>ガス中絶縁破壊電圧の実測結果(FOV)および解析結果(TDIV<sub>50</sub>)を図3に示す.同図には、 $\epsilon$ -FGMスペーサと同一形状・サイズで誘電率一定( $\epsilon_r$ =4)のUniformスペーサの結果も併記している. 同図より、 $\epsilon$ -FGMスペーサのFOVは各圧力においてUniformスペーサのFOVを上回り、0.6 MPaabsにおいて28%高いことがわかる.本NEDOプロジェクトは2022年2月で終了したが、現在、電 力機器メーカーにおいて製品化に向けた検討・開発が行われている.



本研究は、筆者らのオリジナル研究からNEDOプロジェクトに発展したFGMの交流GISスペー サへの適用研究をベースとして、FGMの直流GISスペーサへの適用研究への展開、すなわち、ε -FGMからσ-FGMあるいはε/σ-FGMへの展開を図るものである. 3. 円錐台形スペーサへのσ-FGM適用効果

## 3.1 スペーサモデル

SiCとSiO<sub>2</sub>をフィラーとして充填したエポキシ コンポジットの導電率特性(充填率・電界・温度 依存性)を図4<sup>(6)</sup>に示す.同図より,SiCコンポ ジットの導電率は,SiC充填率,電界,温度とと もに非線形に上昇することがわかる.同図のSiC コンポジットを図5に示す円錐台形スペーサ (SiC充填率:5~10 vol%,U字型)に適用し,平 行平板電極で挟んだ円錐台形 $\sigma$ -FGMスペーサモ デルを想定した.なお,スペーサ内部の比誘電 率は一定( $\epsilon$ ,=4)とした.







図5 円錐台形σ-FGMスペーサモデル

## 3.2 電界緩和効果

図5の円錐台形σ-FGMスペーサモデルの上部電極に高電圧を印加し、下部電極を接地した場合に おける(a)直流電圧20kV印加時,(b)標準雷インパルス電圧100kV印加時の電界解析結果を図6に示 す.各図には、比較のために、SiCを充填していないUniformスペーサ(導電率一定)の電界解析結 果を併記している.各図より、σ-FGMスペーサの場合、Uniformスペーサの場合と比較して、特に 上部電極とスペーサとの接触点(三重点)近傍におけるSF<sub>6</sub>ガス中の電界が大きく緩和されているこ とがわかる.これは、Uniformスペーサの場合には、等電位面が三重点近傍に集中して高電界とな るが、σ-FGMスペーサの場合には、図5のようにスペーサ上部のSiC充填率、すなわち導電率を高 くすることによって等電位面をスペーサ中央方向に押し出し、三重点近傍の電界を緩和しているた めである.



図6 円錐台形σ-FGMスペーサの電界分布

#### 3.3 絶縁破壊電圧向上効果

図6のσ-FGMスペーサによる電界緩和効果を標 準雷インパルス電圧印加による絶縁破壊試験に よって実験的に検証することを試みた. σ-FGM スペーサおよびUniformスペーサについて, Volume-Time理論<sup>(7)</sup>を用いて推定した50%確率の 放電開始電 圧(50% Theoretical Discharge Inception Voltage: TDIV<sub>50</sub>)のSF<sub>6</sub>ガス圧力依存性 を図7に示す. 同図より、σ-FGMスペーサの TDIV<sub>50</sub>は、0.5MPa-absにおいてUniformスペー サのTDIV<sub>50</sub>よりも30%高いことが予想される.



によって作製した.SiC(10vol%)を含むコンポジットAとSiCを含まないコンポジットBをそれぞ れ充填した2本のシリンジ (図8)の注入速度を独立制御 (図9) し,スタティックミキサを介して金型 に充填した(図10). 金型内のコンポジットをオーブンで熱硬化・離型した後, 図5のサイズ(厚さ 10mm)にカッティングしたσ-FGMスペーササンプルを図11に示す. 同様のプロセスにより、コン ポジットBのみでUniformスペーササンプルを作製した.



図10 可変配合注型装置

図11  $\sigma$ -FGMスペーササンプル

 $\sigma$ -FGMスペーササンプルおよびUniformスペーササンプルを0.3MPa-absのSF<sub>6</sub>ガス中に配置し、 正極性標準雷インパルス電圧を絶縁破壊が発生するまで上昇法にて印加した. その結果, Uniform スペーササンプルは130kVで破壊し、図7の推定値(146kV)の89%であった.一方、σ-FGMスペー ササンプルは123kVで破壊し, 推定値(185kV) の66%と低く, Uniform スペーササンプルよ りも低い値となった. また, 図12に示す絶縁 破壊試験後の写真より, Uniform スペーササ ンプルには図6(b)の最大電界である三重点を起 点とする沿面放電痕があるのに対して, σ -FGMスペーササンプルは破損していた. これ



図12 絶縁破壊試験後の放電痕

は、σ-FGMスペーサの導電率が高いことによってスペーサ内部に大きな電流が流れ、電気的な破壊が発生する前に、熱的・機械的な破壊が発生したためと推察される.この推察に立脚した対策として、電源回路における過電流制御用抵抗を高抵抗化して再試験する予定である.さらに、電界解析によるσ-FGMスペーサの電界緩和効果とともに、電流・熱伝導解析によるσ-FGMスペーサの熱的な安定性に関する評価・検証も重要であるという技術課題が明らかとなった.

### 4. コーン型スペーサへの $\varepsilon/\sigma$ -FGM適用効果

## 4.1 スペーサモデル

前章では、円錐台形スペーサモデルを想定し、σ-FGMスペーサの基礎的な電界緩和効果について 検討した.一方、実際のGISスペーサは、同軸円筒構造における内円筒高電圧導体-外円筒接地導体 間のガス空間に設置され、電気的・機械的性能の観点からコーン型であることが多い.そこで、本章で は、2.2節のNEDOプロジェクトにおけるコーン型245kV級GISスペーサを参考にするとともに、将来 的な実験的検証(当研究室所有の高電圧電源の出力制限等)を念頭に置いて、同スペーサと同一形状で サイズを1/4に縮小したモデルとして、図13(a)に示すコーン型スペーサモデル(内半径11.25mm、外半

径30mm)を想定した.電圧レベルは、直流GISスペーサへのFGM適用に関する筆者らの先行研究<sup>(8)</sup>で対象とした直流GIS(320kV,内半径100mm,外半径350mm)内部の電界レベルが同程度となるように、サイズ換算で27kV(≒320×30/350)と設定した.

図13(a)のコーン型スペーサモデルにおいて、 $\epsilon$ と $\sigma$ の両方の空間分布を同時に傾斜させた $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサを想定した. $\epsilon$ 分布の傾斜はSrTiO<sub>3</sub> コンポジット(SrTiO<sub>3</sub>充填率:26.9vol%、 $\epsilon$ が半径 方向に低下するGLP(Grading to Lower Permittivity)型,図13(b))、 $\sigma$ 分布の傾斜はSiCコ ンポジット(SiC充填率:5~10 vol%,U字型,図 13(c)(d))でそれぞれ独立に与えた. $\epsilon$ 分布と $\sigma$ 分布 が独立した $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサは、可変配合注型法 において、必要な種類・充填率のフィラーを含む コンポジット・シリンジを複数準備することに よって作製可能である.



図13 コーン型 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサモデル

#### 4.2 電界緩和効果

図13のコーン型 $\varepsilon/\sigma$ -FGMスペーサモデルの 内円筒導体に直流電圧27kVを印加し,外円筒 導体を接地した場合における電界解析結果を 図14に示す.各図には,比較のために, SrTiO<sub>3</sub>およびSiCを充填していないUniformス ペーサ(誘電率・導電率一定)の電界解析結果を 併記している.また,内円筒導体の温度は GIS運転時の通電電流によって上昇し,ス ペーサへの熱伝達を経てスペーサの導電率分 布,すなわちスペーサ内部およびスペーサ周 囲のガス中電界分布を変歪させる.そこで, 外円筒導体の温度をT<sub>0</sub>=300Kに固定し,内円 筒導体の温度をT=T<sub>0</sub>+ $\Delta$ Tとし, $\Delta$ T=0~70Kを パラメータとして電界解析を行った.

図14(a)より,Uniformスペーサ・ΔT=0Kの 場合,コーン型スペーサの凹面側・内円筒導体 近傍が最大電界となるが,ΔTの上昇とともに 最大電界が凸面側・スペーサ沿面上を経て,凸 面側・接地導体近傍に推移することがわかる. これは,Uniformスペーサ(SiC充填率: 0vol%)においても,図4で示した導電率の温 度依存性により,高温の内円筒導体近傍にお けるスペーサの導電率が上昇し,等電位面を スペーサ中央方向に押し出すことによって内



円筒導体近傍の電界が緩和され、スペーサ中央や外円筒導体近傍の電界が強調されるためである. このように、従来型のUniformスペーサにおいては、直流GIS運転時におけるスペーサ周囲のガス 中最大電界の大きさや位置が、内円筒導体の温度、すなわち直流GIS運転時の通電電流に大きく依 存し、電気絶縁設計・運用上の問題となっている.

一方,図14(b)の $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサの場合,U字型の $\sigma$ 分布,特にスペーサ外周部の高い導電率 によって外円筒導体近傍の電界が緩和される.ガス中最大電界の $\Delta$ T依存性を図15に示す.同図よ り、 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサの最大電界の $\Delta$ T依存性は小さく、特に $\Delta$ Tの大きい領域において、 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサの最大電界緩和効果が顕著になり、 $\Delta$ T=70Kにおいて45%に達することがわかる.  $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサの最大電界の $\Delta$ T依存性が小さいことは、導電率の電界依存性と温度依存性が、 SiC充填率の空間分布、すなわちFGM化することによってバランスよく制御されているためであ ると考えられる.

次に、コーン型 $\varepsilon/\sigma$ -FGMスペーサモデル( $\Delta$ T=0K)における標準電インパルス電圧100kV印加時の電界解析結果を図16に示す.同図より、標準電インパルス電圧印加時の最大電界の位置は、

Uniformスペーサおよび $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサと もに凹面側・内円筒導体近傍にあり、ε/σ -FGMスペーサのガス中最大電界はUniformス ペーサよりも25%低減されていることがわか る. また、両スペーサと誘電率分布のみ傾斜 させた $\epsilon$ (GLP)/ $\sigma$ (Uniform)-FGMスペーサ( $\epsilon$ -FGMスペーサと等価)における電界推移を図 17に示す. 同図より、 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサと $\epsilon$ (GLP)/σ(Uniform)-FGMの電界推移は一致し ていることがわかる.これは、直流GISにお いても標準雷インパルス電圧印加時のガス中 電界は、交流GISと同様に誘電率に支配され ることに起因している. さらに、誘電率の温 度依存性はないため、標準雷インパルス電圧 印加時におけるε/σ-FGMスペーサの電界緩 和効果のΔT依存性はない.

以上より、直流GISスペーサにFGMを適用 する場合には、直流電圧印加時のような導電 率支配の電界のみならず、標準雷インパルス 電圧印加時のような誘電率支配の電界も制 御・緩和するために、 $\sigma$ -FGMよりも $\varepsilon/\sigma$ -FGMの方が効果的であると言うことができ る.

### 4.3 絶縁破壊電圧向上効果

3.3節と同様に、コーン型 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペー サとUniformスペーサについて、標準雷イン パルス電圧印加時におけるTDIV<sub>50</sub>のSF<sub>6</sub>ガス 圧力依存性を推定した結果を図18に示す.同 図より、 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサのTDIV<sub>50</sub> は、 0.5MPa-absにおいてUniformスペーサの TDIV<sub>50</sub>よりも26%高いことが予想される.こ の26%のTDIV<sub>50</sub>向上効果が単純にスペーサ直 径の小型化に寄与するとすると、GIS断面積 およびSF<sub>6</sub>ガス使用量は55% (= $(1-0.26)^2$ )に 低減されることが期待される.

今後, 図13のε/σ-FGMスペーサを可変配 合注型法によって作製し, 標準雷インパルス









電圧印加による絶縁破壊試験により、絶縁破壊電圧向上効果を実験的に検証する予定である.

### 5. まとめ

本研究では、自然エネルギー由来の発電技術の普及拡大とともに送電技術のキーテクノロジーと して期待されている高電圧直流送電について、主要機器である直流ガス絶縁開閉装置(GIS)の小型 化および地球温暖化係数の高いSF<sub>6</sub>ガス使用量の削減を目的として、GISのサイズを支配するス ペーサへの傾斜機能材料(FGM)の適用可能性を検討した.基礎的な円錐台形スペーサモデルおよ び実用的なコーン型スペーサモデルについて、スペーサ内部の導電率および誘電率の空間分布を想 定し、FGMスペーサ周囲のガス空間の電界緩和効果および絶縁破壊電圧向上効果を評価した.そ の結果、導電率(σ)と誘電率(ε)の空間分布を独立制御したε/σ-FGMスペーサの適用により、コー ン型スペーサモデルの最大電界を直流電圧印加時に45%、標準電インパルス電圧印加時に25%緩和 し、標準雷インパルス電圧印加時の絶縁破壊電圧を26%向上し、SF<sub>6</sub>ガス使用量を55%に低減し得 ることを示唆した.

今後の予定および技術課題として、以下の6項目が挙げられる.

(1) 円錐台形σ-FGMスペーササンプルの絶縁破壊試験の再試験および熱的安定性評価

3.3節で述べたように、絶縁破壊試験の電源回路における過電流制御用抵抗を高抵抗化し、 円錐台形 $\sigma$ -FGMスペーササンプルを再試験するとともに、電流・熱伝導解析によって $\sigma$ -FGM スペーサの熱的な安定性を評価・検証する予定である.

(2) コーン型 $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーササンプルの作製および絶縁破壊試験

4.3節で述べたように, ε/σ-FGMスペーササンプルを可変配合注型法によって作製し, 絶縁 破壊電圧向上効果を実験的に検証する予定である.

(3) ε/σ分布の最適化

本研究で想定した $\epsilon/\sigma$ 分布はあくまでも一例であり、より効果的な電界緩和・絶縁破壊電圧 向上効果を得るためには、 $\epsilon/\sigma$ 分布の最適化が期待される.これには、最大電界や絶縁破壊電 圧の目標値を設定し、それを可能とする $\epsilon/\sigma$ 分布を求解するという逆問題を解く方法がある. NEDOプロジェクトでは、 $\epsilon$ 分布( $\epsilon$ -FGMスペーサ)を対象とした最適化方法が提案・検証され ており<sup>(9)</sup>、これを $\epsilon/\sigma$ 分布( $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサ)に展開する.

(4) ε/σ分布の作製精度の検証

可変配合注型法によって作製した $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーササンプルの $\epsilon/\sigma$ 分布を非破壊で測定し、 想定した $\epsilon/\sigma$ 分布との作製精度を検証する必要がある.NEDOプロジェクトでは、 $\epsilon$ 分布( $\epsilon$ -FGMスペーサ)を対象としてX線CTが適用可能であることが検証されており<sup>(10)</sup>、これを $\sigma$ 分布 ( $\sigma$ -FGMスペーサ)および $\epsilon/\sigma$ 分布( $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサ)に展開する.

(5) スペーサ沿面付着異物の影響評価

GISスペーサにおいては、据付・運転中に発生する微小な金属異物がスペーサ沿面に付着し、 絶縁性能を低下させることがある。 $\sigma$ -FGMスペーサおよび $\varepsilon/\sigma$ -FGMスペーサにおいても、ス ペーサ沿面付着異物の影響を評価する.

(6) GIS以外のガス絶縁電力機器, SF<sub>6</sub>ガス以外のガスへのFGMの適用拡大

本研究では、GIS、SF<sub>6</sub>ガスを対象としたが、他のガス絶縁電力機器(GIL等)やガス(SF<sub>6</sub>/N<sub>2</sub>

混合ガス等のSF<sub>6</sub>代替ガス)への $\sigma$ -FGMスペーサおよび $\epsilon/\sigma$ -FGMスペーサの適用効果を評価し、適用拡大の可能性を検討する.

## 参考文献

- A.Kuechler: "High Voltage Engineering Fundamentals Technology Application", pp.86-89, Springer (2017)
- (2) 早川:「コンポジット絶縁材料の実機適用を目指した開発事例(GIS用FGMスペーサ)」,電気学会全国大会シンポジウム, S2-7 (2022)
- (3) 足立:「「電力機器用革新的機能性絶縁材料の技術開発」プロジェクト概要」, 電気学会全国 大会シンポジウム, S1-2 (2019)
- (4) K.Adachi, et al.: "Development of New Types of Insulators for Electric Power Apparatuses Using Nanocomposites and Functionally Graded Materials", International Conference on Dielectrics (ICD), pp.317-320 (2020)
- (5) Y.Miyazaki, et al.: "Breakdown Characteristics of Cone-type ε-FGM Spacer for Gas Insulated Switchgears", 電気学会基礎・材料・共通部門誌, 141巻10号, pp.546-551 (2021)
- (6) Rachmawati, et al.: "Application of SiC-filled Permittivity and Conductivity Graded Material (ε / σ -FGM) in HVDC GIS Spacer", International Symposium on High Voltage Engineering (ISH), No.705 (2021)
- (7) N.Hayakawa, et al.: "Simulation on Discharge Inception Voltage Improvement of GIS Spacer with Permittivity Graded Materials (ε-FGM) by Flexible Mixture Casting Method", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.25, No.4, pp. 1318-1323 (2018)
- (8) Rachmawati, et al.: "Electric Field Simulation of Permittivity and Conductivity Graded Material ( ε / σ -FGM) for HVDC GIS Spacers", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol.28, No.2, pp. 736-744 (2021)
- (9) K. Kato et al, "Inverse analysis of optimum permittivity distribution for FGM spacer in consideration with multiple objective functions in gaseous insulation systems", International Symposium on High Voltage Engineering (ISH), No.401 (2021)
- (10)加藤,他:「X線CTを用いた誘電率傾斜機能材料(ε-FGM)の誘電率分布測定」,電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会,A5-7 (2021)